

L05C I-line stepper 破片線曝光條件與製程規格

破片種類：厚度 < 720 um 之 Si、化合物半導體、glass 等

破片尺寸：25*25 (標準)、12*12、20*20、40*40 mm²、2"、4"

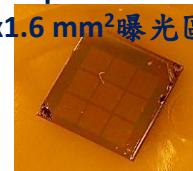
9in1光罩 layout範圍：1.6*1.6、3.2X3.2 mm² (標準)

曝光 map：12 *12 mm²的破片曝3X3個die、

25*25 mm²的破片曝5X5個die

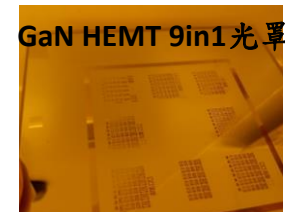
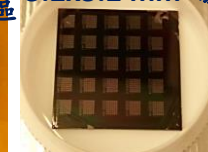
3x3 map

1.6x1.6 mm²曝光區



5x5 map

3.2x3.2 mm²曝光區



解析度 / 對準誤差：0.4 um 以上 (single line) / 1 um (only TVPA)

排程：每周二、四 14:00 ~ 16:00 (依 L05C 申請單編號排序)

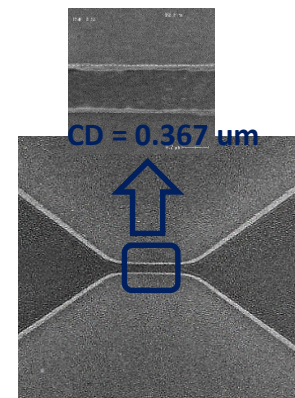
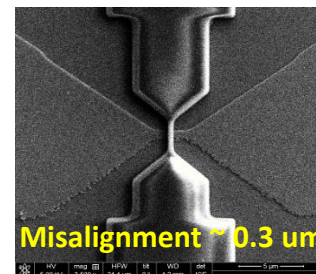
注意：1. 需對準之破片，請以切割機完成切片

2. 多層對準，需先破片，再曝零層

3. 破片曝光，需提供dummy片

4. 非標準破片尺寸洽工程師

5. 與其他曝光工具mix-match的曝光技術洽工程師



工程師：許進財 7648